

GC/MSによる 発生ガス濃縮装置を用いたアウトガス分析

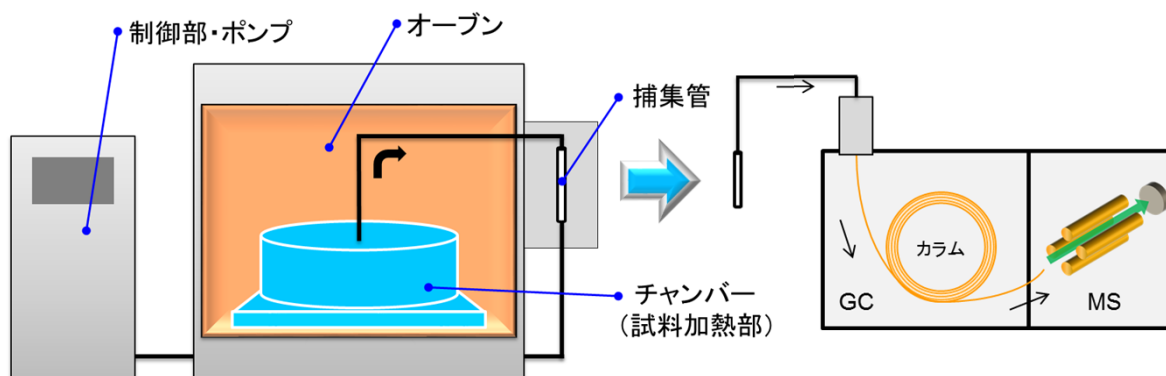
GC/MS:ガスクロマトグラフィー質量分析法

概要

発生ガス濃縮装置はチャンバー内に入れた試料から発生したガスを捕集管にトラップさせる装置です。捕集管にトラップすることで微量の脱ガス成分を濃縮し、GC/MSで高感度に測定できます。試料の種類に合わせて、適したサイズのチャンバーを選択することができ、最大350°Cまでの加熱に対応しています。

装置構成

■本体



■チャンバー



サイズ : 220mm φ × 7mm
材質 : 石英
適合試料 : ウエハ



サイズ : 220mm φ × 60mm
材質 : 石英
適合試料 : 樹脂部材など

仕様・特徴

■特徴

- 比較的大きいサイズ(数cmオーダー)のサンプルに対応
- ヘッドスペース法と比較して2~3桁程度感度良く測定が可能
- ウエハ両面からの有機汚染評価が可能
- フォトマスク(レチクル)の有機汚染評価が可能
- ヘキサデカン、デカメチルシクロペンタシロキサンなどを用いた換算定量が可能

■仕様

- ・ 搬入可能サイズ : 上記チャンバーに入るサイズ
- ・ 加熱雰囲気 : 不活性ガス(N₂)
- ・ 加熱条件 : 室温~最大350°Cまでの昇温加熱

■注意点

- ・ 低沸点成分は捕集できない場合があります
- ・ 脱ガス量の多い試料は加熱温度を制限させていただくか、切断して一部を測定する場合があります

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <https://www.mst.or.jp/>